## 四特 許 公 報(B2)

昭63-30730

(a) Int Cl. 4 H (b) J 11/00 11/02 識別記号

**庁内整理番号** 

❷❸公告 昭和63年(1988)6月20日

F-8725-5C B-8725-5C

発明の数 1 (全8頁)

9発明の名称	セルフシフト形ガス放電ノ	ペネル
	②特 顧 昭5	56-97745
	<b>金出 願 昭5</b>	66(1981) 6月23日
700発明。者	佐藤精酸	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
伊発明 者	监 谷 雅 行	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
伊発明 者	沖 賢 —	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
伊 発明 者	三補照信	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
伊 発明者	山口久	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
砂発 明 者	宮下 義則	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内
砂発明 者	傑 田 傳	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
砂発明 者	吉川 和生	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
砂発明 者	倉橋 敬三	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
砂発明 者	河田 外与志	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
勿出 願 人	富士通株式会社	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
砂代 理 人	弁理士 井桁 貞一	
審査官	伊 坪 公 一	
日本考文献	特開 昭57-107536(JP	', A)

1

## **砂特許護求の範囲**

1 複数の母線X1, X2, Y1, Y2に順次規則的に接続されたシフト電極xi, xsj, yi, ysi を電荷蓄積用の誘電体層3, 6で被覆してガス放電空間1に対面させて複数のシフト放電セル 5 (ai, bi, ci, di, az, bz, .....) の規則的配列よりなるシフトチャンネル8 a~8 Cを構成するとともに、該シフトチャンネルの一端に書込み電極9を設けて普込み放電セルWを構成してなるセ

2

ルフシフト形ガス放電パネルにおいて、

前記書込み放電セルWを含んだシフトチャンネル8 a~8 Cの少なくとも両端部の放電セルW, bnを定める電極部位の近傍に対応した誘電体層3,8上に、所定の電位にクランプされた電荷リーク用の導電体層11W,11Eを設けたことを特徴とするセルフシフト形ガス放電パネル。2 前記シフトチャンネル8 a~8 Cの少なくとも両端部に設けられた電荷リーク用の導電体層1

1W, 11Eが互いに連結した構造を有すること を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のセル フシフト形ガス放電パネル。

## 発明の詳細な説明

この発明は、放電スポットのシフト機能をそな 5 えたいわゆるセルフシフト形ガス放電パネルの改 良に係り、特に異常電荷の偏在によって引き起こ される偶発的な誤放電を防止するようにした新し いパネル構造に関するものである。

ACメモリ駆動形のプラズマデイスプレイに分類 され、放電スポットの形で鸖込まれた情報をその ままのパターンでシフトして所定の位置に静止表 示する機能をそなえている。しかして当該パネル で被覆された構成を有するものであるが、従来か かる構成のパネルにおいては動作中に偶発的な異 常放電が発生してパネル内の表示情報が乱された り、誘電体層が破壊するという問題を生じてい の形で表示情報に対応する放電スポット群の周囲 に現れたり、あるいは稻光のように瞬時的に発光 した後、比較的大きい発光パターンとして現れる ものである。

号等にて周知のシフト動作に空間電荷の結合を積 極的に利用するようにしたいわゆる空間電荷結合 方式の駆動法を採るよりも、特開昭49-43535号 (U.S.P.No3781600) に示された、シフト動作に壁 電荷の結合を積極的に利用するようにしたいわゆ 30 問題がある。 る壁電荷転送方式の駆動法を採用した場合に特に 著しいものである。従つて、その原因はシフト勁 作の繰り返しに伴つてシフトチャンネルの両端す なわち掛込み放電セルと終端シフト放電セルの電 蓄積されていく点にあるものと考えられている。 第1図はかかる電荷の偏在個様を模式的に示した 図で、横軸が紙面の右側を書込み端部としたシフ トチャンネルを示し、縦軸が電位を示す。このよ 著しくなつて一定値を越えると、この異伏壁電荷 に基づく異常電界がシフト電圧等の外部電界と共 同してその近傍に雪崩現象を誘発し、先に述べた ような情報に基づかない異常放電を生じるわけで

ある。

さて上配のような異常放電を避けるためには、 シフトチヤンネル両端部の電極に異常蓄積電荷の 排出機能を持たせれば良く、例えば先に引用した 特開昭49-43535号に示された形式のガス放電バ ネルにおいては、シフトチャンネル両端部の電極 をガス放電空間に直接露出させて電荷の蓄積を不 能とした構成が採用されている。ところが、上述 のごとき露出電極を用いると、放電時のイオン衝 一般に、セルフシフト形のガス放電パネルは、 10 撃によつて電極材料がスパッタしたり、また放電 ガス空間を封止する際のシール材の焼成工程時に 電極の酸化が生じ、いずれにしても当該電極近傍 の放電特性が変化して動作寿命が短いという不利 がある。加えて、書込み電圧マージンの上限が低 の電極はメモリ機能達成のために当然に誘電体層 15 下するという問題もある。すなわち、露出した書 込み電極に書込み電圧を印加した際、そこには比 較的長い時間にわたつて大電流が流れるために、 書込み電極で定まる書込み放電セルには強い放電 が比較的長い時間持続することになり、この放電 た。なお、異常放電の形態は、単位放電スポット 20 は隣接するシフト放電セルに不要の放電を引き起 こす。従つて、前配書込み電圧の上限は低く抑え る必要があるわけである。

他方、シフトチャンネル両端部の電極対応誘電 体層に電荷排出のためのピンホールや亀裂を与え このような偶発的異常放電は、特開昭53-8053 25 る考え方も先に特願昭54-164319号(特公昭58-56455号)等によつて提案されているが、かかる 構成では特性の均一なパネルを再現性良く作るの が困難な状況にある他、この場合も顕著ではない が亀裂の存在によつて電極の酸化が生じるという

この発明は、以上のような従来の駆動法および パネル構造における問題点を解消した新しいセル フシフト形ガス放電パネルを提供するものであ る。さらに詳細には、本発明の目的はシフトチャ 極対応誘電体層表面に異常電荷が分極した状態で 35 ンネルの少なくとも両端部における異常電荷の著 積を避けるための最も現実的なパネル構造を提供 することである。簡単に述べるとこの発明は、シ フトチヤンネルの少なくとも両端部の放電セルを 定める電極部位の近傍に対応した電荷蓄積用誘電 うな壁電荷の偏在がシフト動作の繰返しによつて 40 体層上に、所定の電位にクランプされた電荷リー ク用の導電体層を設けてそれにより電荷をリーク して排出させるようにしたことを特徴とするもの である。

以下、この発明の好ましい実施例につき第2図



以下の図面を参照してさらに詳細に説明する。

第2図a~cは、この発明を平行する電極リー ド導体を持つセルフシフト形ガス放電パネルに適 用した場合の1例構成を示す要部断面図と分解し て示した要部平面図で、パネルの電極配列自体 5 は、例えば特別昭53-17059号等にて周知のよう な2×2相の構成となつている。すなわち、ガス 放電空間 1 をはさんで対向配置した 1 方のガラス 基板2の内面には2相の母線Y1,Y2にそれぞ れ平行のリード導体(第2図a参照)を介して交 10 る。 互に接続された2群のY側シフト電極yiiとyiiが あり表面を誘電体層3とMgOの表面層4で覆わ れている。また他方のガラス基板5の内面には別 の2相の母線X1, X2にそれぞれ平行のリード X側シフト電極xijとxjがあり同じく表面を誘電 体層:6とMgOの表面層で覆われている。そし てこれらX例シフト電極とY側シフト電極とは、 相互に半ピッチ分オフセットした関係で対向し、 た形のシフト放電セル配列ai, bi, ci, di, az… …を回定している。このようなシフト放電セルの 規則的配列によって図の場合3本のシフトチャン ネル8 a~8 cが構成され、さらに該シフトチャ れぞれ設けられて、最初のシフト電極Yuとの間 に書込み放電セルWを構成している。

さてここまでの構成は上に参照した特別昭53-17059号公報記載のパネル構成とさして変わらな 込み放電セルWを含めたシフトチャンネルの両端 部の放電セル、すなわち書込み放電セルWと終端 シフト放電セルbnを定める電極部位の近傍に対 応した誘電体層3, 6上に、所定電位にクランプ 図示の如く設けられている点で大きく異なつてい る。この導電体階11W,11Eとしては、パネ ル形成時の熱プロセスを経ても比較的安定であ り、放電の基本的特性を支配する表面層を汚染す ば酸化インジウム (In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸化スズ (SnO<sub>2</sub>) およびそれらの混合材料 (ITO) 等が使用可能で ある。なお本実施例の場合、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を使用してお り、以下これを電荷リーク層と呼ぶことにする。

また、これらの電荷リーク層11Wと11Eは、 所定の電位にクランプすべく外部の駆動回路に接 続するために、図示のごとくパネル端部に導出さ れている。具体的には、直流電源に接続すれば良 いが、本例では11Wは前記母線X2に接続し、 11日は接地電位に接続している。要するに、こ れら電荷リーク層は、その表面に電荷が蓄積して そこの電位に変化が生じたときその電位を元に戻 すように電荷の移動を生じる作用をするものであ

かくして、上記のごとくシフトチャンネルの両 端セルに近接して誘電体層3.6に電荷リーク層 11W, 11Eを設ければ、それら両セルに対応 する誘電体層上におけるシフト放電に不要の壁電 導体(第2図c参照)を介して交互に接続された 15 荷はこの電荷リーク層により速やかにリークす る。要するに、誤放電を生じるような異常な電荷 の蓄積は起こらなくなる。なお、電荷リーク層1 1W, 11Eは片側の電極基板だけに形成しても 良い。これを前述した壁電荷転送タイプの駆動法 それらの間に順次一方の電極を隣接セルに共用し 20 の面から今少し具体的に説明すると、第3図は書 込み電極端子Wと各シフト用母線とに印加する駆 動電圧波形をそれぞれ符号を対応させて示す図 で、SPは普込みおよびシフト期間、DPは表示期 間である。この第3図の駆動電圧波形から明らか ンネルの右端に端子Wに連なる番込み電極 8 がそ 25 なように、期間TOの書込み時には、書込み電極 8に正極性の書込み電圧Vwが印加されて書込み 放電が生じるから、当該書込み電極対応の誘電体 表面層7の上にはマイナスの壁電荷が形成され、 対向するシフト電極yii対応の誘電体表面層4の い。しかしながら、この発明においては、上記書 30 上にはプラスの壁電荷が形成された状態となる。 そして以後のシフト動作は、引続くシフト電極の: 電圧をVshのシフト電位から順次接地電位に落し てプラスの壁電荷を転送して行く形となるから、 シフト後のセル表面にはマイナス電荷が取り残さ された電荷リーク用の導電体層11Wと11Eが 35 れることになる。そしてこのような書込み動作と シフト動作を繰り仮して行く内に、中間のシフト 放電セルでは毎回極性反転による壁電荷の中和消 滅がなされるので残留電荷の累積作用は前配第1 図で示すように比較的少ないが、書込み電極対応 ることのないもので形成するのが望ましく、例え 40 部ではマイナス電荷が滞留累積して負に帯電し、 シフト終端部では転送されたプラス電荷が累積し て正に帯電して行くわけである。しかるに、この 発明のように書込みセルWおよび終端シフトセル bn位置の近傍の誘電体層上に電荷リーク層 1 1

ることにより封止部12を形成する。そしてさら に、前記電荷リーク層11W, 11Eを蒸着マス ク等で遮へいした状態でMgOを蒸着法により被

W, 11Eを設けておけば、放電に伴なつて生ず るマイナス電荷のほとんどはガス空間に露出した 電荷リーク層11Wに蓄積した後、前配母線X2 にリークし、同じく用済みのプラス電荷のほとん どは電荷リーク層 11日に蓄積した後接地電位源 5 膜厚約5000人の表面層 4,7を形成する。 にリークし、結果として前記両端セル対応の誘電 体表面層には誤放電を生じるような異常な電荷の **蓄積は起こらない。なお、書込み側の電荷リーク** 個11Wにはシフト電圧が印加されているけれど ることはない。

以上のように形成された1対のガラス基板2と 5を約90~110μmの間隊 (放電空間) を保つよ うにスペーサ(図示せず)を介在させて対向配置 してから封止材の本焼成後、前配放電空間に放電 もこれによってそれら対向部において放電が生じ 10 ガスを封入する工程を加えれば、前述したような セルフシフト形ガス放電パネルが得られることに なる。なお、電荷リーク層 1 1 W, 1 1 E となる in<sub>2</sub>O<sub>2</sub>層は、封止材の焼成時に熱的影響を受けて MgO表面層 4, 7を汚染することは全くない。 電特性の安定化は所望どおり得ることができる。

着し、それによって電極対応の誘電体層上にのみ

さて次に、上記のようなパネルを製造するため の方法について簡単に説明する。すなわち、先ず ガラス基板2と5上にスパッタリング法等によって て、膜厚750Åのクロム (Cr) / 膜厚2μmの鋼 15 従つて、この表面層の働きによる低電圧駆動と放 《Cu》/膜厚750Åのクロム (Cr) の3層構造の 電極導体を一旦形成した後、パネル組立後に封止 部外になる位置の表面Cr層のみを残して他の部 分の表面Cr層をエッチング法により除去し、結 で、所望の電極パターンでパターニング/エッチ ングを行なつて第2図示の如きシフト電極yii, yei, xij, xejおよび書込み電極 9 を形成する。次 にこの電極形成基板上に真空蒸着法等によって、 する。ここまでのパネル製造工程は、従来良く知 られているものであり、以上の場合薄膜技術に基 づいて説明したが、従来汎用の厚膜技術による機 - 造(例えばAuペーストによる電極と低融点ガラ スによる誘電体層との組合わせ)であつても良 30 ことができる。 .61

以上この発明の一実施例について説明したので あるが、本発明の本質はかかる実施例に限らず、 他に種々の変形と拡張が可能である。例えば、異 果としてCr/Cu2層の電極導体を形成する。ここ 20 常電荷をリークするための電荷リーク層は、先の 実施例で述べたごとくシフトチャンネル両端部の 放電セル位置に近接した電荷蓄積用誘電体層上に 設けるだけでなく、Y側電極について第4図の要 部平面図の斜線部118で示すようにシフトチャ 膜厚  $5 \sim 10$ μmの $Al_2O_3$ の誘電体層 3 と 6 を形成 25 ンネルの全放電セルについてそれら各セルを定め る電極上の誘電体層を避けた近傍の誘電体層上に **設けても良い。このように構成すれば、チャンネ** ル中央部近辺のシブト放電に不要の余分な電荷も リークできるので、一層安定した放電特性を得る

しかして次に、前記電荷リーク閣 1 1 W. 11 Eの形状に合つた阴口を持つ蒸碧マスクを前記誘 電体層3,6上に載置し、その状態で蒸着法によ つて膜厚2000~10000ÅのIn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>を被着する。かく 35 すれば誘電体層上には、前配第2図に示すような 電荷リーク層11W,11Eが形成されることに なる。なお、他の方法として、誘電体層3,6全 前にIneOsを被着した後、レジストを塗布してか らにHCI液などを用いてエッチングし、所定形状 の電荷リーク層を形成する方法も適用できる。

また、電荷リーク層11W, 11Eは、第5図 aおよびbにおいて書込み側について斜線で示す ようなパターンも適用可能であり、その材料とし てAu、Pt等の貴金属も適用できる。

この後、封止用の低融点ガラスをガラス基板周 辺にスクリーン印刷してから約420℃で仮焼成す

さらに、シフトチヤンネルの両端部に設けた電 荷リーク暦11Wと11Eは、前述の実施例では 各々所定の電位源に接続していたが、Y側電極基 板についてそれらを例えば第8図に示すように基 板上または基板外で互いに連結するよう構成すれ らパターン用フイルムを用いて露光、現像し、さ 40 ば、かかる電位源への接続は必ずしも必要でな

> そしてさらに、適用するパネルは、先に述べた ごとく平行する電極リード導体構造を持つセルフ シフト形ガス放電パネルの他に、前述した特開昭

53-8053号にて提案されたミアンダ電極構造を持 つパネルや、ミアンダ形のシフトチャンネルを持 つパネル、電極群数を 2群× 2群以上に増加した 電極樹造を有するパネルや、平行電極構造をそな えたパネル、あるいはマトリックス電極機造およ びモノリシック構造を有するパネル等に適用可能 である。

さて以上の説明から明らかなように、要するに この発明はACメモリ駆動形式のセルフシフト形 なくとも両端郎の放電セルを定める電極部位の近 傍に対応した電荷蓄積用誘電体層上に異常壁電荷 の蓄積を不能にするための所定電位にクランプさ れた電荷リーク用の導電体層を設けているので、 セルフシフト形パネル特有の異常電荷の偏在によ 15 発明の変形例を模式的に示す要部平面図である。 つて引き起こされる偶発的な誤放電を防止するこ とができる。また、前記シフトチャンネルの両側 **蟷電極は誘電体層によつて保護しているので、放** 電時においてスパッタされることがなく、またガ ス空間の封止作業中において酸化されることもな 20 導電体層、12:封止部。 い。加えて、電荷リーク圏の材料として、パネル

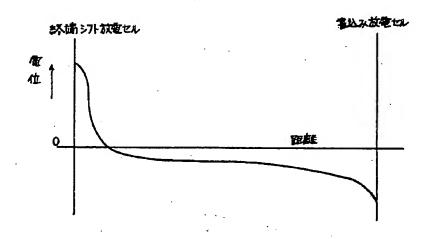
形成時の熱プロセスを経ても安定で誘電体表面層 を汚染しないものを選んでいる。従って、特性が 安定で長寿命動作を達成することができる。ゆえ ・に、この発明はACメモリ駆動形式のセルフシフ 5 ト形ガス放電パネルの性能向上にきわめて有益で ある。

## 図面の簡単な説明

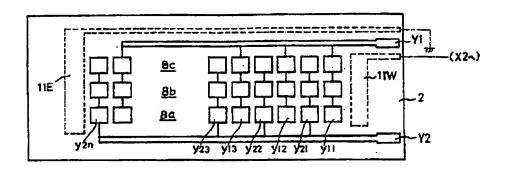
第1図はACメモリ駆動形式のセルフシフト形 ガス放電パネルにおける偶発的な異常放電の発生 ガス放電パネルにおいて、シフトチャンネルの少 10 を説明するための電荷分布図、第2図 a~cはこ の発明を適用した平行する電極リード導体構造を 持つセルフシフト形ガス放電パネルを示す要部断 面図と分解した平面図、第3図は動作を説明する ための駆動電圧波形図、第4図及至第8図はこの

> 1:ガス放電空間、2および5:ガラス基板、 3 および.8:誘電体層、4 および7:表面層、8 a~8c:シフトチヤンネル、8:書込み電極、 11W, 11Eおよび11S: 異常電荷リーク用

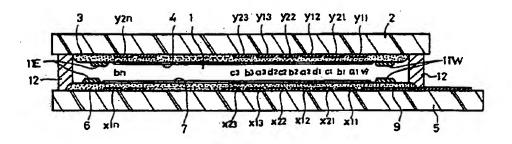
第1図



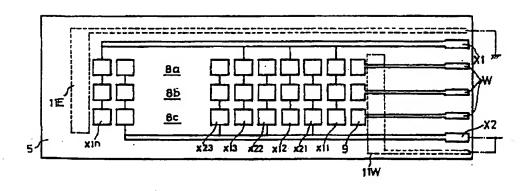
第2図a



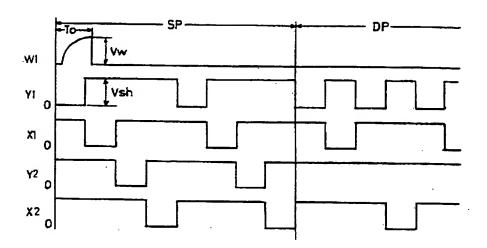
第2図 b



第2図 c

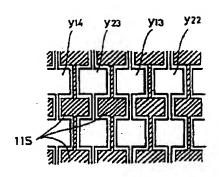


第3図



第4図 a

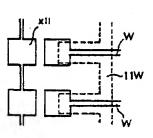
第4図 b

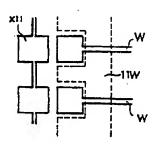


115 Y14 Y23 Y13 Y22

第5図 a

第5図 b





第.6 図

